氟化铅 (PbF₂) 薄膜的红外光学特性

周 明 李复蝉

(西南技术物理研究所,成都)

摘要:本文报导了 PbF_2 薄膜在红外区域的光学特性。对光谱法求折射率的有关公式行进了修正,还给出了 PbF_2 薄膜的折射率,并且认为 PbF_2 是一种较好的红外镀膜材料。

IR optical character of PbF, film

Zhou Ming , Li Fuchan
(Southwest Institute of Technical Physics)

Abstract: The infraed spectrum character of the PbF₂ thin film is presented. The formula used to calculate the optical index of the thin film from the spectrum character is modified and according to the modified formula, the optical index of PbF₂ thin film is obtained. It is pointed out that the PbF₂ is a good material for infrared coating.

近年来,随着国内外光学技术的发展,特别是 CO_2 激光技术的进步,人们对红外光学薄膜提出了更高的要求。常规的ZnSe、ZnS及Ge膜已远不能满足红外镀膜的要求。为此,不得不寻求新的红外镀膜材料,在众多的氟化物中,似乎 PbF_2 是一种极有希望的红外镀膜材料。首先, PbF_2 有较低的折射率、透过光谱区宽广,大致可透过到 $17\mu m^{11},^{21}$ 。其次, PbF_2 薄膜具有低应力的特点,很适用于镀制厚的红外薄膜。由于 PbF_2 薄膜的这些特性,国外 已 将 PbF_2 应用于镀制 CO_2 激光输出窗 I^3I_0 。尽管如此,几乎未看到有关 PbF_2 薄膜光学性质的 报导。为了探索 PbF_2 薄膜在大功率 CO_2 激光器中的应用前景,我们对 PbF_2 薄膜的光学特性作了一系列的实验和研究,本文将报导一些初步的实验结果。

二、PbF2薄膜的镀制及其光谱

目前国内还未见有市售的 PbF_2 膜料,我们的 PbF_2 膜料是委托上海有关单位试制的。**蒸镀前,** PbF_2 在大气中烘烤处理7h,处理温度为 $350 \, ^{\circ} ^{\circ}$ 。在 H44 • 550 -1 型镀膜机上,用钼舟**蒸发,镀制了一批实验**样品,蒸发速率为 $28 \, ^{\circ} ^{\circ}$ /s。

利用PE983G型红外分光光度计,对所镀样品作了较宽的红外光谱测试,光谱曲线如图1所示。

(2)

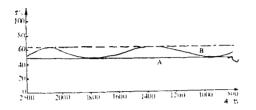


图1 PbF,单层薄膜镀于Ge基片的 光谱及其包络曲线

A-光洁Ge基片的诱射光谱 B-PbF。镀于Ge基片上的光谱

三、PbF。菠腹折射率的计算

光谱包络法是测量折射率最方便而又有效 的方法之一, 文献[4]、[5]对此有详细的论 述. 不讨文献中的公式仅适合于薄膜的折射率 高于基片的折射率的情况, 当薄膜折射率低干 基片折射率时, 文献[4]、[5]中的有关折射率 的公式应作如下的修改:

$$n = -\frac{1}{2} \left[\sqrt{|8n, n_0|^2 C(\lambda) + (n, -1)^2|} \pm \sqrt{|8n, n_0|^2 C(\lambda) + (n, +1)^2|} \right]$$
(1)
$$C(\lambda) = \pm |T^+(\lambda) - T^-(\lambda)| / (2T^+(\lambda)T^-(\lambda))$$
(2)

式中, n_1 、 n_0 分别为基片和空气的折射率。 $T^+(\lambda)$ 、 $T^-(\lambda)$ 分别为透射光谱极大值 包 络 值和 极小 值 包 络值。(1)式中"+"、"-"号的选取应根据薄膜的其它信息来确定。当n< n.时,两种解都具有物理意义,但我们只能选取接近块状材料折射率的解,当n>n,时,则只 能选取正解; (2) 式中n < n, 时, $C(\lambda)$ 应为负, 这是因为反射系数此时有 π 的相移, n > n. 时, $C(\lambda)$ 则应为正。

利用图1中光谱极值的包络曲线,由公式 (1)、(2) 可以计算出PbF2的折射率如图 2。

由于水吸收峰的影响, 短波方向的折射率 仅供参考,在图1中曲线A是光洁锗基片的透 射光谱,曲线B是镀PbF。后的光谱、PbF。薄 膜厚度 $nd = \lambda = 10.60 \mu m$; 如果 PbF。薄 膜在 10.60µm 处 无 吸 收,按照薄膜光学原理,镀

> 前、镀后的基 片透射率应相

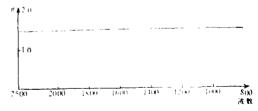


图2 PbF。薄膜折射率随波数的变化

等。从图1可以看出,其透射率是相等的。我们认为PbFz薄 膜在10.60µm处没有可测的吸收。

1000

图3 PbF, /ZnSe组合镀 制的输出镜 ZnSe 基 底, 膜系为HLHLHL /ZnSe/L

四、PbF。遺膜的应用

由于PbF₂薄膜的红外折射率低,对ZnSe基片有很好的 增透效果,但因PbF。薄膜不耐潮湿,增透膜外面还应加镀 保护膜层。用PbF2和ZnSe组合镀制硒化锌窗口,则较为理 想,只需要镀六层就能达到R=85%的反射率,而且薄膜牢 固、抗潮,具有良好的机械特性,图3是六层PbF2/ZnSe组 成的硒化锌部分反射膜的光谱曲线。

将镀制的PbF2/ZnSe膜在水中浸泡一周,而未见膜裂 或其它异常现象。

根据我们所作的实验和所测量的光谱曲线, PbF₂ 具有

激光合成非晶态Si₃N₄粉末

李道火 仲志英 刘宗才 赵秉纯 李建国 浦 坦 赵华珍 刘昌好 詹合英 花春贵 (中国科学院安徽光机所, 合肥)

摘要:本文描述了大功率CO2激光辐照SiH4+NH3的快速流动气体合成Si3H4起细粉末的实验,揭示了激光谱线变化对合成反应的影响。讨论了粉末红外吸收光谱的畸变现象等。

Synthesizing amorphous SisN, powders by laser

Li Daohuo, Zong Zhiying, Liu Zongcai, Zhao Bingchun, Li Jianguo Pu Tan, Zhao Huazhen, Liu Changhao, Zhan Heying, Hua Chungui (Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Academic Sinica)

Abstract. The experiment of synthesizing superfine Si₃N, powder by using the CW CO₂ laser to irradiate the fast flowing gases (SiH, +NH₃) is described. The effect of the laser spectrum variation on the synthesis reaction has been revealed. The deformation phenomenon of the infrared absorption spectrum of the powder has been discovered.

较宽的透射光谱,在中红外区域(4.5μ m~ 11μ m)内未见吸收峰存在,不失为一种较好的中红外镀膜材料。

最后, 谨向黄芳鹏、唐和玲同志表示感谢, 他们分别提供了膜料和样品的测试数据。

参考 文献

- [1] 麦克带德H.A著,周九林,尹树百译。光学薄膜技术。北京: 国防工业 出 版 社,1974:455
- (2) Sankur H. Appl Opt, 1986, 25(12): 1962
- (3) Malherbe A, Geenen B. Laser Focus, 1987; 23(1): 26
- (4) Aktulga E. Appl Opt, 1985; 24(4): 490
- [5] 周 明。兵器激光, 1986, 44(4): 51

作者简介:周 明,见本刊1989年,第3期第52页。

李复蝉,女,1941年1月出生。高级工程师。现从事光学薄膜工艺工作。

收稿日期: 1990年7月10日。